

ナノテク産業化基盤技術の有効利用および 高度化と融合を目指した研究会2015

2015 **3/13 Fri** 13:00-17:45

※参加無料※

電子顕微鏡によるエネルギー分散型X線分光法(XEDS)に関して、高純度シリコンドリフト型検出器SDDの出現によって、いろいろな検出効率改善の試みがなされています。今回はこれらの新しい技術紹介をする機会を設けました。この他に、特別講演として企業の研究者から“材料の微細構造解析に関わる話題”を提供していただきます。

皆様奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。

プログラム

1. センター長挨拶
2. 高効率X線検出装置(Dual SDD)の開発(60分)
福永 啓一 日本電子
3. Designing a large SDD solid angle EDX system with low spurious peaks and a high Fiori Peak-to-Background ratio - An EDX system for all applications(60分)
Alex Bright FEI Company Japan Ltd.
- 休憩----(30分)
4. STEM用マイクロカロリメーター XEDSの開発(60分)
田中 啓一 日立ハイテクサイエンス
5. 特別講演
先端解析技術を駆使した鉄鋼材料の研究・開発と“文科省設備共用制度:微細構造解析プラットフォーム”への期待(60分)
佐藤 馨 JFEスチール
6. 九州大学学術研究都市づくりの取り組みについて(10分)
山浦 輝久 (公財)九州大学学術研究都市推進機構

技術交流会 学内レストラン「天天」18:00-19:30

開催場所

九州大学伊都キャンパス

伊都ゲストハウス

〒819-0395 福岡市西区元岡744



主催

九州大学 超顕微解析研究センター / 文科省 微細構造解析プラットフォーム
九州大学 学術研究都市推進機構(OPACK)

後援

日本電子株式会社 / 株式会社日立ハイテクサイエンス / 日本FEI

お問い合わせ

友清 芳二 九州大学超顕微解析研究センター

〒819-0395福岡市西区元岡744

TEL:092-802-3292, e-mail: tomokiyo.yoshitsugu.620@m.kyushu-u.ac.jp